



## KMP-2DT 双盘双控金相磨抛机



### 一、用途和特点

在金相试样制备过程中，试样的磨、抛光是必不可少的工序，试样经过磨抛后，可获得光亮如镜的表面。KMP-2DT 金相试样磨抛机采用了高端触摸屏，可使磨抛盘的转速在 50-1000r/min 之间无极可调，通过更换金相砂纸和抛光织物可以完成试样的磨、抛工序，展现了更广泛的应用性。壳体采用整体吸塑，外观新颖，具有转动平稳、噪声小、操作方便、工作效率高等特点，并自带冷却装置，可以在磨抛时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织。适用于工厂、大专院校、科研单位的金相实验室，是金相试样磨抛的好设备。

### 二、产品优势

- 1.壳体采用高端 ABS 一体成型，外观新颖，高端大气上档次。
- 2.水龙头采用全铜镀铬工艺，防腐蚀性好。
- 3.带自动清洗功能，可对集污槽进行自动清洗，让集污槽保持清洁。（选配）
- 4.直流无刷电机，转动平稳，噪音低，寿命长。（选配）



- 5.无极调速加八挡定速，方便快捷满足各种需求。
- 6.倒计时功能，时间任意设定，到时停机。(选配)
- 7.磨抛盘可以进行顺时针或逆时针旋转，适应不同需要。
- 8.双盘双控使用更加灵活，让制样效率更加高效。
- 9.可选配带胶砂纸和抛光布专用磁性盘和防粘盘，替代标配的卡圈。(选配)

### 三、技术参数

技术参数	名称:	规格:
	磨盘直径	标配 $\phi$ 203mm(可定制 $\phi$ 230mm、 $\phi$ 250mm)
	磨盘转速	50-1000r/min (无极调速)
	电源	电压: 220V 频率: 50HZ
	电机	0.55KW
	外形尺寸	730×765×320mm
	重量	42Kg

### 四、装箱单

型号	产品名称		单位	数量
KMP-2DT	金相试样磨抛机		台	1
产品附件	单位	数量	备注	
磨抛盘	个	2	已安装在设备上	
挡水圈	个	2	已安装在设备上	
压圈	个	2	已安装在设备上	
水砂纸	张	2	$\Phi$ 203mm	
抛光织物	张	2	$\Phi$ 203mm	



**浙江科标技术有限公司**  
**Zhejiang Kebiao Technology Co., Ltd**

---

进水管	根	1	6分接口
出水管	根	1	Φ32
技术文件	1.产品说明书 1份		2.产品合格证 1份